函館工業高等専門学校			開講年度			授業科目	卒業研究(設計加工履修コー			
科目基礎			און דושנויו	開講年度 十成20年度 (2010年度) 技業符目 ス)						
ツロ茎灰 4目番号	門甲牧	0169			東明 / .次	専門 / 必修				
3日留亏 受業形態				科目区分 単位の種別と単位						
3条心思_ 開設学科		_	実験・実習 生産システム工学科			5	. 0			
開設期		生産ンステムエ子科 通年			対象学年 5 週時間数 8					
*************************************	 ŧ材	地十			短点的数 0					
旦当教員	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	 川上 健作,近藤 司,古俣 和直,山田 誠,中村 尚彦,浜 克己,本村 真治,鈴木 学,剱地 利昭,川合 政人,高田 明雄,三島 裕樹,山 田 一雅,丸山 珠美,森谷 健二,森田 孝,湊 賢一,柳谷 俊一,下町 健太朗,河合 博之,後藤 等,高橋 直樹,国分 進,今野 慎介,佐 藤 恵一,小山 慎哉,倉山 めぐみ,太刀川 寛,東海林 智也,藤原 孝洋								
到達目標	Ę									
2. 専門工 3. 技術的 4. 問題を	成果を正確 解決するた	基礎知識・	技術を説明できる。 論理的な文書にまと 持ち、解決手法をも	≤め、的確にプレゼ き案できる。	ンテーションするこ	ことができる。				
ルーブリ	<u> </u>		T		T					
			理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安			
評価項目1			研究を計画的に継続して遂行でき る。		研究を継続して遂行できる。		研究を継続して遂行できない。			
評価項目2			および関連する	専門工学に関する基礎知識・技術 および関連する他分野の基礎知識 ・技術を説明できる。		基礎知識・技術	専門工学に関する基礎知識・技術 を説明できない。			
評価項目3			的な文書にまと	確な日本語で論理 め、的確にプレゼ ることができる。	的確にプレゼーめ、プレゼンテーション		技術的成果を論理的な文書にまとめ、プレゼンテーションすること ができない。			
評価項目4			問題を解決するための知識を持ち 、最適な解決策を提案できる。		問題を解決するための知識を持ち 、解決手法を考案できる。		問題を解決するための知識を持ち 、解決手法を考案できない。			
学科の到	」達目標項	目との関	 係				•			
IABEE学習	引・教育到達 教育目標 C 🛭	目標 (E-4)	JABEE学習・教育: JABEE学習・教育: JABEE学習・教育: 打目標 E 函館高専教	到達目標 (F-1) JAE	BEE学習・教育到達 BEE学習・教育到達 BEE学習・教育到達	目標 (B-4) JAB 目標 (E-2) JAB 目標 (F-2) 函館	EE学習・教育到達目標 (C-1) EE学習・教育到達目標 (E-3) 高専教育目標 A 函館高専教育目標 E			
概要		に考え,	学習してきたことを基礎として,各自に与えられた研究テーマについて指導教員の指導の下に,自ら積極的 主的にテーマに取り組むことで,ものづくりを実践する。研究成果を論文にまとめ,発表することによって コミュニケーション能力を身に付ける。							
ることを理合は何らか こと。 授業の進め方・方法 2. 卒業研究 4. 研究時 た卒業研究			はの研究も授業では習っていない内容を多く含む。また、それぞれの研究室で研究の進め方や指導方法も異ないでは当教員とよく話をして十分納得の上で研究室を選ぶこと。なお、希望の研究室が定員に達した場合がある。主体的に研究課題に取り組むこと。 持究は学生が主役である。主体的に研究課題に取り組むこと。 持行った場合は、研究日誌にその日の研究成果を記入すること。 持間(コンタクトタイムを含む)がJABEE認定に必要な最低時間を越えていたとしても、授業時間に定められるの時間帯には研究を行うこと。 中学業論文を提出しない場合や発表を行わなかった場合は卒業研究は不合格とする。							
注意点		JABEE教 •口頭発 3:60%) 質疑応5% •研究活	育到達目標評価: 表30%(予稿5%) / 6 (E-1:100%)) 動(日誌)30%(A	(B-3:40%, E-2:	30%, E-4:30%),発表20%(B-3:20%, B-4:20%, E- , F-1:10%, F-2:20%)			
授業計画		•			·					
		週	授業内容		į,	週ごとの到達目標				
前期	1stQ		卒業研究に取り組むであるので,各自たに取り組むことはたてグローバルマネシ 学生も,同様に以	学科に関連する次の は、デーマリストは が指導教員と議論し たいに歓迎したい。 デメント履修コースの ボディケニーで ファイアニーで デロッチ	あくまでも予定 で新たなテーマ 各エースしておい 各に所属の研究にいる いたからの アンとGM履修コ					

		_		
			【設計・加工履修コースに関連するテーマ】 「横傾斜対応型パワーアシスト車椅子の開発」	
			(浜) 非回転工具を用いた6軸制御加工」 (山田)	
			「低抵抗ビストンボンブの開発」(本村) 「カルシウム硬度調整水中に浸漬した鋼の分極抵	
			抗測定」(古俣) 「NC加工作業における切削油供給監視システムの	
		2週	開発」(近藤) 「介護・福祉機器の人間工学に基づく設計」(川	
			上) 「箸型自助器具の改良に関する実験と設計製作	
			(中村) 「洋上風力発電に適した風車形状の実験的検討」	
			(剱地) 「複数移動ロボットの隊列移動に関する研究」	
			(鈴木) 「高バッファ圧力に対応したエアモーターの開発	
			」(川合)	
			【エネルギー履修コースに関連するテーマ】 	
			する実験的検証」(本村) 「ヒートパイプの環境性能試験」(山田誠)	
		3週	「電力・エネルギーシステムに関する研究」(三 島)	
			「熱電変換材料の作製および解析」(柳谷) 「教室における暖房使用時の室温不均一に対する強	
			制循環の効果」(剱地) 「ガスハイドレートの解離膨張特性を利用した発	
			電システムの開発」(川合)	
			【回路エレクトロニクス履修コースに関連するテーマ】	
			「電磁界解析の応用に関する研究」(森田) 「非線形回路の解析と応用」(高田)	
			「アモルファス材料の物性の研究」(山田一雅) 「熱電変換材料の作製および解析」(柳谷)	
		4週	「生体情報計測と解析」「介護・福祉機器の開発 」(森谷)	
			「色素増感太陽電池に関する研究」(湊) 「空手組手の動作識別に関する研究」(佐藤恵一	
) 「H <u>8ボー</u> ドによる小型ロボット用組み込みOSの	
			開発」(高橋) 【IT・ソフトウェア履修コースに関連するテーマ】	
			「無線ネットワークを用いた情報収集システムアーキテクチャに関する研究」 (藤原)	
			「コンピュータのパカ」 (MR/K) 「コンピュータのインタラウションを利用した学習支援システムの設計開発とその利用」 (倉山)	
			「ウェアラブルセンサを活用したソフトウェアの 開発」(今野)	
			「空手組手の動作識別に関する研究」(佐藤恵一 、	
		5週	, 「H8ボードによる小型ロボット用組み込みOSの開発」(高橋)	
			「モバイル向け音楽教育支援アプリの開発」(東海林)	
			「有向グラフの辺彩色とその応用に関する研究」	
			(河合) 「Javaアプレットによるソーティングアルゴリズ	
			ム学習コンテンツの開発」(後藤) 「データベース連携Webアプリケーションの開発	
			」 (小山) 【ロボティクス履修コースに関連するテーマ】	
			「サーボモータを用いた6足歩行ロボットの開発」 」(浜)	
			「動作解析技術の臨床応用」(川上) 「kinectとロボットを用いた認知症予防」(中村	
		C)III) 「ものつくりに関する研究」(森田)	
		6週	「ロボットへリに関する研究」(山田一雅) 「生体情報計測と解析」「介護・福祉機器の開発	
			」(森谷) 「複数移動ロボットの隊列移動に関する研究」(鈴	
			木) 「身体障がい者向け自動車運転技術在宅訓練シス	
		-\E	テムの開発」(小山)	
		7週 8週		
		9週		
	2ndQ	10週		
		11週 12週		
		13週		
		14週		
		15週 16週		
後期	3rdQ	1週		

		2週						
		3週						
		4週						
		5週						
		6週						
		7週						
		8週						
	411.0	9週						
		10週						
		11週						
		12週						
	4thQ	13週						
		14週						
		15週						
		16週						
モデルコ	アカリ	ノキュラムの:	学習内容と	到達目標				
分類								
評価割合	``	1	1				'	1
		 試験	発表	相互評価	態度	研究活動	論文	合計
総合評価割合		0	30	0	0	30	40	100
基礎的能力		0	0	0	0	0	0	0
専門的能力		0	10	0	0	0	10	20
分野横断的能力		0	20		0	30	30	80
	用しノノ	U	120	0	Įυ	130	130	[00